от Микроскопические исследования системы полиимид–С₇₀

© Н.В. Каманина, Ю.М. Воронин

Федеральное государственное унитарное предприятие "Всероссийский научный центр Государственный оптический институт им. С.И.Вавилова", С.-Петербург

E-mail: kamanin@ffm.ioffe.rssi.ru

Поступило в Редакцию 23 апреля 2002 г.

Проведены исследования структуры полиимид–С₇₀ на электронном микроскопе HU-11В при ускоряющем напряжении 75 kV. Показан процесс формирования пленки сопряженной органической системы на примере полиимидной матрицы при сенсибилизации последней фуллеренами.

Перспективность использования фуллеренов С₆₀ и С₇₀ для полиимидных систем была показана в ряде публикаций [1–9]. В работах [1–4] было найдено существование сдвига в сторону длинных волн в спектрах поглощения фуллеренсодержащего полиимида, обнаружено увеличение фотопроводимости, показана зависимость уровня оптического ограничения излучения видимого диапазона спектра от концентрации фуллеренов и установлена возможность модуляции лазерного излучения данными структурами. Для той же системы в работах [5,6] продемонстрировано нелинейное ослабление лазерного излучения ближнего ИК диапазона на длине волны 1315 nm и показана эффективность управления данным процессом при учете спектральных особенностей лампы вспышки иодного лазера. Непосредственным доказательством проявления фоторефрактивного эффекта в фуллеренсодержащих образцах полиимидов явилась фазовая запись тонких дифракционных решеток на длине волны $\lambda = 532 \,\mathrm{nm}$ в нано- и пикосекундном диапазонах длительностей лазерного импульса на достаточно высокой пространственной частоте $\sim 100 \, \mathrm{mm^{-1}}$ [7,8]. Определен порог перехода фазовой решетки в амплитудную, рассчитано значение наведенного показателя преломления из зависимости дифракционной эффективности от плотности энергии считывающего излучения. Установлена возможность использования полимер-диспергированных жидкокристаллических систем на

6

основе указанных выше полиимидных матриц для целей ограничения излучения и записи голограмм [9].

Стоит сказать, что во всех проведенных исследованиях по изучению эффекта ограничения и записи голограмм было показано, что системы, сенсибилизированные фуллеренами, проявляют достаточно высокие параметры по лучевой прочности и термостойкости, что поставило вопрос о необходимости более скрупулезного микроскопического изучения самой структуры пленки фуллеренсодержащего полиимида, выяснения роли и влияния фуллереновых молекул на процесс образования пленки сенсибилизированного полимера.

В настоящей работе изучались образцы полиимидов 6В, полученные из 3%-ных растворов фоточувствительных композиций в тетрахлорэтане. В качестве сенсибилизаторов использовались фуллерены C_{60} и C_{70} в количестве 0.2–0.5 wt.% по отношению к сухому веществую полиимида. Капли раствора наносились на поверхность дистиллированной воды и собирались на медные сетки с последующей сушкой в течение 8–12 часов до полного удаления растворителя. Толщина полученных образцов составляла ~ 0.1 микрона.

Пленки исследовались на электронном микроскопе HU-11В при ускоряющем напряжении 75 kV. Электронное увеличение равнялось 12 500[×]. С целью улучшения контраста электронного изображения снимки получали при частичной недофокусировке. Заметим, что возможность использования указанной выше аппаратуры для исследования углеродных пленок была показана ранее в работе [10].

На рис. 1 и 2 приведены первые результаты микроскопического исследования системы полиимид-фуллерен. Показан процесс образования пленки сопряженной полиимидной матрицы при ее сенсибилизации фуллереном С₇₀. Рис. 1 демонстрирует изображение, состоящее из фуллереновых структур различной конфигурации, образующих замкнутые и разорванные цепочки квазипентагональной и гексагональной формы. Хорошо виден процесс агрегации фуллереновых кластеров в глобулы, причем размер отдельных глобул достигает 10–50 nm. Размер замкнутых фуллереновых конфигураций составляет ~ 200 nm. Различие в контрасте фуллереновых конфигураций и матричного пленкообразующего материала связано, по-видимому, с различным молекулярным весом молекулы полиимида и фуллерена С₇₀. Заметим, что молекулярный вес мономерного фоточувствительного звена в молекуле полиимида составляет 750 (для фуллерена С₇₀ эта величина равна 840).



Рис. 1. Электронное изображение фуллереновых структур различной конфигурации, образующих цепочки квазипентагональной и гексагональной формы.



Рис. 2. Пример образования пленки полимера на "каркасе", созданном фуллереновыми цепочками квазипентагональной и гексагональной формы.

На рис. 2 показано формирование пленки полимера на фуллереновом "каркасе". Видно, что произошло частичное сшивание незамкнутых цепочек, отдельные же фуллереновые кластеры присутствуют как между соседними цепочками на границе их раздела, так и внутри кольцевых соединений. Стоит сказать, что подобная картина образования пленок органических соединений, установленная для структуры полиимид-С70, с одной стороны, достаточно хорошо объясняет высокие прочностные параметры материалов с фуллеренами и не противоречит данным работы [11], где показан пример образования высокопрочного нанокомпозитного резиста; с другой стороны, помогает понять процессы синтеза однородной пленки с последующией записью на ней интерференционной картины. Действительно, при засветке структуры лазерным излучением с размером пятна 3-5 mm световое поле интегрально воздействует на пленку органического соединения, не создавая градиента показателя преломления за счет неоднородностей структуры и не активируя светоиндуцированное рассеяние на этих неоднородностях, а вызывая протекание фоторефрактивных процессов при изменении пути переноса носителей заряда с донорного фрагмента органической молекулы не на ее внутримолекулярный акцептор, а на фуллерен, энергия сродства к электрону которого в несколько раз превосходит данную величину для многих органических акцепторов.

Таким образом, в данной работе продемонстрировано образование сопряженных органических тонкопленочных структур на основе фуллеренсодержащего полиимида и показана роль фуллереновых кластеров в этом процессе.

Работа выполнена при частичной поддержке гранта РФФИ № 00-15-99067.

Список литературы

- [1] Kamanina N.V., Kaporskii L.N., Kotov B.V. // Opt. Commun. 1998. V. 152. N 4-6. P. 280-282.
- [2] Cherkasov Y.A., Kamanina N.V., Alexandrova E.L., Berendyaev V.I., Vasilenko N.A., Kotov B.V. // Proceed. of SPIE. 1998. V. 3471. P. 254–260.
- [3] Kamanina N.V. // Opt. Commun. 1999. V. 162. N 4-6. P. 228-232.
- [4] Kamanina N.V., Vasilenko N.A. // Nonlinear Optics. 2000. V. 25. P. 207-212.

- [5] Kamanina N.V., Bagrov I.V., Belousova I.M., Kognovitskii S.O., Zhevlakov A.P. // Opt. Commun. 2001. V. 194. N 4–6. P. 367–372.
- [6] Каманина Н.В., Багров И.В., Белоусова И.М., Жевлаков А.П // Оптика и спектроскопия. 2001. Т. 91. № 1. С. 5–7.
- [7] Каманина Н.В. // Оптика и спектроскопия. 2001. Т. 90. № 6. С. 960-964.
- [8] Kamanina N.V. // Synthetic Metals. 2002. V. 127. N 1-3. P. 121-128.
- [9] Kamanina N.V., Putilin S., Stasel'ko D. // Synthetic Metals. 2002. V. 127. N 1–3.
 P. 129–133.
- [10] Воронин Ю.М., Вознесенский Н.Б. // Оптический журнал. 1998. Т. 65. № 1. С. 94–96.
- [11] Tomohiro Shibata, Tetsuyoshi Ishii, Hiroshi Nozawa, Toshiaki Tamamura // Jap. J. Appl. Phys. 1997. V. 36. N 12B. P. 7642–7645.